経過報告:FemAFMへのDLVO理論機能追加作業



2017.12.06 by AAS

DNA分子のAFMシミュレーション 高さ一定モード ピラミッド型探針



DLVO理論を考慮せず、ファン デルワールス力だけでシミュ レーションしたAFM像

イオン溶液濃度:0.01[M] イオン電荷:z=±1 温度:300[K] 溶液の比誘電率:80.4 探針の表面電位(バックグランドー定値):-0.05[V] 表面電位に由来する探針の表面電荷密度:-0.0115[C/m2] 試料の表面電位(バックグランドー定値):-0.05[V] 表面電位に由来する試料の表面電荷密度:-0.0115[C/m2] デバイ長さ:3.09E-9[m]



イオン溶液濃度:0.1[M] イオン電荷:z=±1 温度:300[K] 溶液の比誘電率:80.4 探針の表面電位(バックグランドー定値):-0.05[V] 表面電位に由来する探針の表面電荷密度:-0.0365[C/m2] 試料の表面電位(バックグランドー定値):-0.05[V] 表面電位に由来する試料の表面電荷密度:-0.0365[C/m2] デバイ長さ:9.77E-10[m]



イオン溶液濃度:0.5[M] イオン電荷:z=±1 温度:300[K] 溶液の比誘電率:80.4 探針の表面電位(バックグランドー定値):-0.01[V] 表面電位に由来する探針の表面電荷密度:-0.0163[C/m2] 試料の表面電位(バックグランドー定値):-0.01[V] 表面電位に由来する試料の表面電荷密度:-0.0163[C/m2] デバイ長さ:4.37E-10[m]



イオン溶液濃度:0.5[M] イオン電荷:z=±1 温度:300[K] 溶液の比誘電率:80.4 探針の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する探針の表面電荷密度:-0.0407[C/m2] 試料の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する試料の表面電荷密度:-0.0407[C/m2] デバイ長さ:4.37E-10[m]



DNA分子のらせん構造が 良く表れている

イオン溶液濃度:0.3[M] イオン電荷:z=±1 温度:300[K] 溶液の比誘電率:80.4 探針の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する探針の表面電荷密度:-0.0316[C/m2] 試料の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する試料の表面電荷密度:-0.0316[C/m2] デバイ長さ:5.64E-10[m]



イオン溶液濃度:0.01[M] イオン電荷:z=±1 温度:300[K] 溶液の比誘電率:80.4 探針の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する探針の表面電荷密度:-0.00576[C/m2] 試料の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する試料の表面電荷密度:-0.00576[C/m2] デバイ長さ:3.09E-9[m]



ピラミッド型探針の形状の 影響がAFM像に表れている

経過報告:FemAFMへのDLVO理論機能追加作業



2017.12.06 by AAS

DNA分子のAFMシミュレーション 高さ一定モード 球形探針

イオン溶液濃度:0.01[M] イオン電荷:z=±1 温度:300[K] 溶液の比誘電率:80.4 探針の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する探針の表面電荷密度:-0.00576[C/m2] 試料の表面電位(バックグランドー定値):-0.025[V] 表面電位に由来する試料の表面電荷密度:-0.00576[C/m2] デバイ長さ:3.09E-9[m]



探針形状が球形のため、AFM 像がぼやけてしまっている